Влияние токовой локализации на внутреннюю квантовую эффективность светодиодов InAsSb/InAs

© Я.Я. Кудрик, А.В. Зиновчук

06

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева, Киев, Украина Житомирский государственный университет им. И. Франко, Житомир, Украина

E-mail: zinovchuk.a@zu.edu.ua

Поступило в Редакцию 11 января 2012 г.

Исследовано влияние токовой локализации на внутреннюю квантовую эффективность (ВКЭ) светодиодов InAsSb/InAs среднего инфракрасного (ИК) диапазона ($\lambda = 3-5\,\mu$ m). Расчет на основе модифицированной модели рекомбинационных коэффициентов показывает, что токовая локализация приводит к значительному уменьшению ВКЭ светодиодов. Эффект уменьшения становится особенно заметным в более длинноволновых светодиодах (23% для $\lambda = 3.4\,\mu$ m и 39% для $\lambda = 4.2\,\mu$ m). Представленные результаты свидетельствуют о том, что токовую локализацию необходимо принимать во внимание как один из дополнительных нетермических механизмов падения эффективности в ИКсветодиодах.

Одной из общих проблем для светодиодов разных спектральных диапазонов является эффект токовой локализации. Этот эффект состоит в локализации линий протекания тока в некоторых областях многослойной структуры светодиодов вследствие достаточно высоких удельных сопротивлений слоев и конструктивных особенностей внешнего дизайна светодиода, связанных с необходимостью вывода излучения. Эффект локализации хорошо известен в светодиодах как видимого (InGaN [1], ALGaInP [2]), так и ИК (InAsSb [3]) диапазонов. Представлено несколько публикаций по численному [4,5] и аналитическому [1,6,7] моделированию растекания тока в светодиодах. Эти работы направлены на улучшение растекания тока по активной области приборов путем оптимизации внутренних параметров (сопротивления и толщины подложки, ограничивающих слоев, слоев растекания) и геометрии контактов. Также в них отмечается, что токовая локализация

14

приводит к активации безызлучательной рекомбинации, локальному разогреву структуры и, как следствие, к уменьшению квантовой эффективности светодиодов. Однако количественных расчетов влияния локализации на ВКЭ светодиодов ранее не проводилось. Вследствие доминирующей роли безызлучательной оже-рекомбинации в узкозонных полупроводниках, эффекты локализации должны быть особенно актуальными в светодиодах среднего ИК-диапазона. Поэтому объектами нашего исследования были светодиоды среднего ИК-диапазона на основе гетероструктур InAsSb/InAs, технология изготовления и основные параметры которых хорошо известны из литературы [8,9]. В данной работе были рассчитаны зависимости ВКЭ светодиодов InAsSb от уровня инжекции с учетом эффекта токовой локализации.

Нами рассматривались светодиоды InAsSb/InAs стандартной планарной конфигурации с круглым контактом радиуса $r_0 = 50 \, \mu m$ на верхней поверхности (рис. 1, a). В расчетах пространственных распределений плотности тока предполагалось наличие осевой симметрии структуры (светодиоды имеют цилиндрическую форму с радиусом $R = 300 \,\mu m$). Принимая во внимание данные о внутренней структуре светодиодов InAsSb/InAs, представленные в работе [8], в нашей модели учитывались три наиболее важных слоя, каждый из которых характеризовался толщиной и удельным сопротивлением: подложка *p*-InAs (d_n, ρ_n) , активный слой *n*-InAsSb (d_{al}, ρ_{al}) и верхний слой растекания *n*-InAsSbP (d_n, ρ_n) . Мы использовали следующие числовые значения параметров: $d_n = 5\,\mu{
m m}, \ \rho_n = 6.2\cdot 10^{-4}\Omega\cdot{
m cm}, \ d_p = 200\,\mu{
m m},$ $ho_p = 4.1 \cdot 10^{-2} \Omega \cdot cm, \ d_{al} = 2 \, \mu m.$ Считалось, что активный слой характеризуется нелинейным сопротивлением *p*-*n*-перехода, которое рассчитывалось исходя из диодной вольт-амперной характеристики: $ho_{al}=arphi_{al}/(d_{al}j_0(\exp(earphi_{al}/eta kT)-1)),$ где $arphi_{al}$ — падение потенциала на активном слое, k — постоянная Больцмана, T — температура, e — заряд электрона, β — фактор идеальности p-n-перехода, j_0 — плотность тока насыщения. Во всех расчетах принимали $\beta = 1, T = 300$ K, а также ток насыщения рассчитывался из формулы Шокли в теории идеального p-n-перехода [10]. Известно, что, изменяя концентрацию Sb в активном слое InAsSb, можно изменять длину волны светодиодов в пределах среднего ИК-диапазона. В данной работе рассматривались светодиоды, изулчающие на трех практически важных длинах волн $\lambda = 3.4, 3.8$ и 4.2 µm. Единственным различием между моделями светодиодов для разных длин волн было значение плотности тока насыщения j_0 , которое



Письма в ЖТФ, 2012, том 38, вып. 10

Рис. 1. Схема поперечного сечения планарного светодиода (a). Нормированные распределения плотности тока в светодиоде на $\lambda = 3.8 \,\mu\text{m}$ в зависимости от уровня инжекции (b) и длины волны светодиода при $I = 30 \,\text{mA}$ (c). Начало отсчета соответствует краю *n*-контакта. ВАХ светодиодов на разные длины волн с учетом эффекта локализации (d).

зависит от ширины запрещенной зоны активного слоя InAsSb (E_g) : $j_0 \sim \exp(-E_g/kT)$.

Применяя законы Кирхгофа к эквивалентной цепи светодиода, показанной на рис. 1, a, можно показать, что зависимость электрического потенциала (φ) в верхнем *n*-слое от радиальной координаты (r) описывается уравнением

$$\frac{d^2\varphi(r)}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{d\varphi(r)}{dr} = \frac{\rho_n}{d_n}j(r),\tag{1}$$

где j(r) — вертикальная компонента плотности тока. Принимая нулевой потенциал на *p*-контакте ($\varphi_p = 0$), падение потенциала от верхнего *n*-слоя к *p*-контакту может быть записано как

$$\varphi(r) = (\rho_p d_p + \rho_{al} d_{al})j(r). \tag{2}$$

Для того чтобы получиь аналитическое решение системы уравнений (1)-(2), мы предположили, что падение потенциала на активном слое не зависит от радиальной координаты *r* и равно разности между приложенным к светодиоду напряжением *V* и падением потенциала на *p*-слое: $\varphi_{al} = V - I(\rho_p d_p)/S$, где *I* — полный ток, а *S* — площадь светодиода. В таких предположениях решение системы уравнений (1)-(2)для плотности тока, соответствующее физическим условиям, можно представить в виде

$$j(r) = \frac{VK_0(\alpha r)}{K_0(\alpha r_0)(\rho_p d_p + \rho_{al} d_{al})},$$
(3)

где $\alpha = \sqrt{\rho_n/(d_n(\rho_p d_p + \rho_{al} d_{al}))}$, а $K_0(\alpha r)$ — модифицированная функция Бесселя второго рода нулевого порядка. Формула (3) представляет собой зависимость плотности тока растекания от расстояния от края верхнего *n*-контакта. Проинтегрировав (3) по всей площади светодиода (считая, что под *n*-контактом плотность равна $j(r_0)$), получаем вольтамперную характеристику светодиода с учетом эффекта локализации (рис. 1, *d*). На рис. 1 показаны радиальные распределения плотности тока в зависимости от уровня инжекции (рис. 1, *b*) и длины волны светодиода (рис. 1, *c*). При малых уровнях инжекции эффект локализации пренебрежимо мал вследствие достаточно большого сопротивления активного слоя (ρ_{al}) по сравнению с сопротивлением остальных слоев.

Увеличение уровня инжекции приводит к быстрому уменьшению ρ_{al} и локализации линий тока под верхним *n*-контактом. Усиление локализации с увеличением длины волны свтеодиода объясняется зависимостью ρ_{al} от ширины запрещенной зоны активного слоя InAsSb. При одинаковом уровне инжекции величина ρ_{al} в длинноволновых светодиодах меньше и токовая локализация происходит сильнее.

Согласно модели рекомбинационных коэффициентов, в стационарных условиях плотность тока в активном слое связана с концентрацией инжектированных носителей *n* соотношением $j/(ed_{al}) =$ $= An + Bn^2 + Cn^3$, где *A*, *B* и *C* — коэффициенты безызлучательной (Шокли-Рида), излучательной и оже-рекомбинации соответственно. Из этого соотношения, используя (3), получаем радиальную зависимость концентрации инжектированных носителей *n*(*r*). Наконец, по известной зависимости *n*(*r*) ВКЭ светодиодов может быть рассчитана как

$$\eta = \frac{P/h\nu}{I/e} = \frac{d_{al}2\pi \int_{0}^{R} Bn^{2}(r)rdr}{I/e},$$
(4)

где P/hv — число фотонов, излученных из активного слоя за секунду (Р — оптическая мощность, hv — энергия фотона), I/e — число электронов, инжектированных в активный слой за секунду. На рис. 2 сравниваются результаты расчета ВКЭ и оптической мощности светодиодов InAsSb для разных длин волн в зависимости от тока. При этом для коэффициента A принималось одно и то же значение $1.0 \cdot 10^6 \, {
m s}^{-1}$ для всех светодиодов. Коэфициенты В и С, в зависимости от ширины запрещенной зоны активного слоя E_g в eV, находились по формулам, представленным в работах [11,12]: $B = 3.0 \cdot 10^{-10} (E_g/1.5)^2 (\text{cm}^3/\text{s})$ и $C = 1.2 \cdot 10^{-27} E_g^{-5/2} \exp(-4.25 E_g) (\text{cm}^6/\text{s})$. Штрихованные кривые на рис. 2 представляют ВКЭ, рассчитанную без учета токовой локализации (ј и п считались пространственно-независимыми). При низких уровнях инжекции $I < 3 \,\mathrm{mA}$ расчет с учетом и без учета эффекта локализации дает одни и те же значения ВКЭ (сплошные и штрихованные кривые совпадают). Однако при высоких уровнях инжекции эффект локализации приводит к значительному уменьшению ВКЭ. Как видно из рис. 1, b, плотность тока под верхним *n*-контактом может быть существенно больше, чем среднее значение плотности тока. Например, при $I = 200 \,\mathrm{mA}$ максимальная плотность тока $j_{\mathrm{max}} = 220 \,\mathrm{A/cm^2}$, тогда



Рис. 2. ВКЭ (*a*) и оптическая мощность (*b*) светодиодов на разные длины волн. Сплошные кривые — расчет с учетом эффекта локализации, штрихованные кривые — без учета локализации.

как среднее значение $j_{av} = 72 \text{ A/cm}^2$. Это приводит к активизации ожерекомбинации в области под верхним *n*-контактом, что сопровождается понижением ВКЭ. Причем, вследствие более сильной локализации тока, в длинноволновых светодиодах уменьшение ВКЭ особенно заметно. Так, при I = 200 mA в светодиоде на $3.4 \,\mu\text{m}$ уменьшение ВКЭ, спровоцированное токовой локализацией, составляет 23%, тогда как в светодиоде на $4.2 \,\mu\text{m} - 39\%$.

В завершение мы представили количественные оценки влияния токовой локализации на падение ВКЭ светодиодах InAsSb среднего ИКдиапазона. Результаты работы показывают, что при высоких уровнях инжекции токовая локализация уменьшает ВКЭ более чем на 20%. Все расчеты проводились без учета саморазогрева, что позволяет рассматривать эффект токовой локализации как дополнительный механизм уменьшения ВКЭ ИК-светодиодов. В отличие от температурного фактора, который может быть частично устранен при импульсном режиме питания, эффект локализации должен приниматься во внимание при разработке новых ИК-светодиодов, работающих как при импульсных, так и при стационарных нагрузках.

Список литературы

- [1] Guo X., Schubert E.F. // J. Appl. Phys. 2001. V. 85. N 8. P. 4191–4195.
- [2] Fletcher R.M., Kuo C.P., Osentowski T.D., Huang K.H., Craford M.G., Robbins V.M. // J. Electron. Mater. 1991. V. 20. N 12. P. 1125–1130.
- [3] Malyutenko V.K., Malyutenko O.Yu., Podoltsev A.D., Kucheryavaya I.N., Matveev B.A., Remennyi M.A., Stus N.M. // Appl. Phys. Lett. 2001. V. 79. N 25. P. 4228–4230.
- [4] Malyutenko V.K., Zinovchuk A.V., Malyutenko O.Yu. // Semicond. Sci. Technol. 2008. V. 23. N 9. P. 085004.
- [5] Evstratov I.Yu., Mymrin V.F., Karpov S.Yu., Makarov Yu.N. // Phys. Status Solidi C. 2006. V. 3. N 6. P. 1645–1648.
- [6] Joyce W.B., Wemple S.H. // J.Appl. Phys. 1970. V. 41. N 9. P. 3818–3830.
- [7] Perks R.M., Porch A., Morgan D.V., Kettle J. // J. Appl. Phys. 2006. V. 100. N 8. P. 083109.
- [8] Зотова Н.В., Кижаев С.С., Молчанов С.С., Молчанова Т.И., Лагунова Т.С., Пушный Б.В., Яковлев Ю.П. // ФТП. 2003. Т. 37. В. 8. С. 980–984.
- [9] Matveev B., Zotova N., Karandashov S., Remennyi M., Il'inskaya N., Stus N., Shustov V., Talalakin G., Malinen J. // IEE Proc. Optoelectron. 1998. V. 145. N 5. P. 254–256.
- [10] Shockley W. // Bell Sys. Tech. J. 1949. V. 28. N 3. P. 435-489.
- [11] Garbuzov D.Z. // J. Luminescence. 1982. V. 27. N 1. P. 109-112.
- [12] Гельмонт Б.Л., Соколова З.Н. // ФТП. 1982. Т. 16. В. 9. С. 1670–1673.